

新闻发布

用于 **HiScroll®** 系列真空泵的新型智能 **AccessLink** 配件接口：运行中更加易于使用和安全

- 全自动气镇阀
- 真空安全阀
- 带集成传感器的全自动压力控制

德国阿斯拉尔，2023年2月22日。普发真空 HiScroll 系列由三个严格密封的干式涡旋泵组成，其额定抽速为 6 至 20 m³/h。这些真空泵的特点是高性能排空和极高能效，以减少碳足迹。

今普发真空推出新型智能 **AccessLink** 配件接口，它能让您使用各种可选配件。

HiScroll 电子设备具有自动识别功能。但在之前必须先进行手动配置配件。这样一个统一的配件接口，意味着运行中更加易于使用和安全。

新的气镇阀可全自动记录各个工艺要求。真空泵可以在一定的时间间隔内控制阀门，或者根据入口压力与另一个配件（集成到 **HiScroll** 中的 **RPT 010** 传感器）一起控制阀门，该传感器由普发真空独家提供。该自动气镇阀也可以通过一个与 **HiScroll** 相连的更高级别的控制器或普发真空的 **OmniControl** 进行手动切换。

新的真空安全阀提高了操作安全性。当泵关闭时，阀门可防止真空法兰处的压力增加。尤其是在发生电源故障的情况下，这显着提高了运行可靠性。这可以防止任何回流（即使是以泵系统中残留气体的形式）进入真空室中。启动 **HiScroll** 时通过延迟打开还防止了冲向真空侧的压力冲击，这对于与涡轮分子泵（如 **Pfeiffer Vacuum HiPace**）一起运行的高真空系统特别有利。

全自动压力控制由（可选）集成在泵中的 RPT 010 测量管负责。这最大限度地减少了泵的磨损，延长了维护周期，并减少了 HiScroll 的功耗和二氧化碳排放量。

普发真空产品经理法比安·博彻(Fabian Böcher)说：“久经考验的普发真空质量确保了新配件经久耐用以及较低的运营成本和环境污染。泵的易维护性不仅缩短了维修服务时间，更可实现极高可用性。内置在泵系统的出口处安全阀和泵的自动控制运行模式可确保安全使用。”

凭借这些特性，HiScroll 真空泵的应用非常广泛，涵盖分析、生物医学、制药行业或研发领域。它们用于质谱、电子显微镜和表面分析，以及加速器和实验室应用，还用于半导体技术、涂层和气体回收。

您可以在此处找到有关的更多信息：

<https://t1p.de/pfeiffer-vacuum-HiScroll-AccessLink-zh>



图片说明：HiScroll 系列的普发真空涡旋泵

您可以在此处找到高分辨率图像，以供下载。

Press Contact:

Pfeiffer Vacuum GmbH

Public Relations

Sabine Neubrand

T +49 6441 802 1223

F +49 6441 802 1500

Sabine.Neubrand@pfeiffer-vacuum.com

www.pfeiffer-vacuum.com

Pfeiffer Vacuum (Shanghai) Co., Ltd.

普发真空技术（上海）有限公司

方子祥 / Steven Fang

Marketing / Marcom Manager

T +86 21-3393 3940 - ext 280

F +86 21-3393 3944

Steven.Fang@pfeiffer-vacuum.cn

3rd Floor, Building 2, Youyou Century Plaza, 428 South Yanggao Road

200127 Shanghai-China

中国上海市浦东新区杨高南路428号由由世纪广场2号楼3楼

About Pfeiffer Vacuum

普发真空- (Stock Exchange Symbol PFV, ISIN DE0006916604)-作为全球领先的真空技术解决方案的供应商之一。我们不仅拥有全系列的复合轴承及全磁悬浮涡轮分子泵,同时还拥有各种旋片泵,干泵,罗茨泵,多级罗茨泵,检漏仪,真空计,质谱仪等产品以及真空管件和系统解决方案。从普发真空发明涡轮分子泵至今,我们在全分析仪器、工业、科研、半导体和前端技术领域,始终代表着创新的解决方案和高品质的产品。公司自1890年创立至今百余年始终走在世界前沿, 在全球拥有 3,500 多名员工, 20 多个办事处和 10 个制造工厂。

更多信息, 请浏览 www.pfeiffer-vacuum.cn